Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

РОЗКЛАД НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

Інституту комп'ютерного моделювання, прикладної фізики та математики
4 курсу в осінньому семестрі 2025/2026 навчального року

Дні	Група / Години	113 Прикладна математика		122 Комп'ютерні науки. Моделювання, проектування та комп'ютерна графіка												105 Прикладна фізика та наноматеріали		153 Мікро- та наносистемна техніка	
		ІКМ-122, ІКМ-122ч 10		**ІКМ-222а** 18		**ІКМ-222б** 11		**ІКМ-222в** 16		**ІКМ-222г** 18		**ІКМ-222д** 14		**ІКМ-222п, ІКМ-222пч** 7		**ІКМ-322б** 3		**ІКМ-422, ІКМ-423с** 12	
Понеділок	8:30			Дисципліна вільного вибору з блоку 1: Теорія прийняття рішень (162) Основи комп'ютерної алгебри (163) Дослідження операцій (162) Методи обробки сигналів (162)											ЛК	Іноземна мова			
	10:25	Програмні засоби моделювання фізичних процесів *(Мартиненко Г.Ю.)*	ЛАБ	Дисципліна вільного вибору з блоку 1: Теорія прийняття рішень (162) Основи комп'ютерної алгебри (163) Дослідження операцій (162) Методи обробки сигналів (162)											ЛАБ	Фізичні основи електроніки *(Копилець І.А.)*	ПР	Матеріали мікро-, наноелектроніки та геліоенергетики	ПР
				Технології анімації та рендерінгу	ЛАБ	Технології анімації та рендерінгу	ЛАБ	Технології анімації та рендерінгу *(Воронцова Д.В.)*	ЛАБ	Технології анімації та рендерінгу	ЛАБ	Технології анімації та рендерінгу	ЛАБ			Основи проф. безпеки та здоров'я людини			ПЗ
	12:35			Технології анімації та рендерінгу *(Воронцова Д.В.)*											ЛК	Фізичні основи електроніки *(Копилець І.А.)*	ЛК	Матеріали мікро-, наноелектроніки та геліоенергетики	ЛК
	14:30	ДВВ 3		ДВВ 3		ДВВ 3		ДВВ 3		ДВВ 3		ДВВ 3		ДВВ 3		Економіка підприємства *(Погорєлов С.М.)*			ЛК ПЗ
	16:25			Дисципліна вільного вибору з блоку 1: Дослідження операцій (162)											Лаб				
Вівторок	8:30																		
	10:25																		
	12:35	ВІЙСЬКОВА ПІДГОТОВКА																	
	14:30																		
	16:25																		
Се	8:30	Стек технологій .NET		Дисципліна вільного вибору з блоку 2: Обробка зображень та мультимедіа (162) Стек технологій .NET (161) Моделювання реалістичних об'єктів в CAD системах (163) Елементи та системи технічного зору (162) Технології глибокого навчання (169)											ЛК				
	10:25	Стек технологій .NET		Дисципліна вільного вибору з блоку 2: Обробка зображень та мультимедіа (162) Стек технологій .NET (161) Моделювання реалістичних об'єктів в CAD системах (163) Елементи та системи технічного зору (162) Технології глибокого навчання (169)											ЛАБ	Методи структурного аналізу *(Малихін С.В.)*	ЛК	Програмовані мікро- та наносистеми	ЛК
		ВВПП 2		Аналіз та тестування програмних систем	ЛАБ					Методологія дослідження систем *(Сидоренко О.С)*	ЛАБ	Deep learning	ЛАБ	Моделі та методи прийняття рішень *(Нікітіна Л.О.)*	ЛБ				

середа	12:35	ВВПП 2		Іноземна мова						Іноземна мова		Deep learning	ЛК	Моделі та методи прийняття рішень *(Нікітіна Л.О.)*	ЛК	Методи структурного аналізу *(Малихін С.В.)*	ЛК ЛАБ	Програмовані мікро- та наносистеми	ЛАБ
	14:30			Розробка додатків за допомогою .Net	ЛК							Програмно-апаратні технології створення РТС	ЛК	Моделі та методи прийняття рішень *(Нікітіна Л.О.)*	ЛБ	Фізичні основи нанотехнологій, *(Сіпатов О.Ю.)*	ЛК	Автоматизоване проектування електронних пристроїв *(Кириленко Я.О,)*	ЛК
	16:25															Фізичні основи нанотехнологій, *(Сіпатов О.Ю.)*	ЛК ПР	Автоматизоване проектування	ПР
Четвер	8:30	ВВПП 3		Дисципліна вільного вибору з блоку 3: Кросплатформене програмування (Java) (161) Основи Web UI (162) Основи дизайну поліграфічних видань (163) Спеціалізовані бази даних (161) Мультиагентні системи і технології (169)											ЛК				
	10:25	ВВПП 3		Дисципліна вільного вибору з блоку 3: Кросплатформене програмування (Java)(161) Основи Web UI (162) Основи дизайну поліграфічних видань (163) Спеціалізовані бази даних (161) Мультиагентні системи і технології (169)											ЛАБ	ДВВ 3 Електронно-оптичний аналіз *(Зубарєв Є.М.)*	ЛК	ДВВ 3	ЛК
		Проєктна робота						Методологія дослідження систем *(Сидоренко О.С.)*	ЛАБ			Програмно-апаратні технології створення РТС	ЛАБ	Мобільні застосунки AR *(Касілов О.В.)*	ЛК				
	12:35	ДВВ 3		ДВВ 3		ДВВ 3		ДВВ 3		ДВВ 3		ДВВ 3		ДВВ 3		Електронно-оптичний аналіз	ЛАБ	ДВВ 3	ЛАБ
		Нейронні мережі та машинне навчання *(Овчаренко В.В.)*	ЛАБ			Нейронні мережі та машинне навчання *(Овчаренко В.В.)*	ЛАБ					Програмно-апаратні технології створення РТС	ЛАБ	Мобільні застосунки AR *(Касілов О.В.)*	ЛК			Електроніка дефектів	ЛК
	14:30	Нейронні мережі та машинне навчання *(Овчаренко В.В.)*	ЛК			Нейронні мережі та машинне навчання *(Овчаренко В.В.)*	ЛК	Іноземна мова		Графіка в мобільних пристроях *(Шеліхова І.Б)*	ЛАБ	Іноземна мова		Мобільні застосунки AR *(Касілов О.В.)*	ЛБ			Електроніка дефектів в напівпровідниках	ЛК ПР
	16:25																	Електроніка дефектів	ПР
П'ятниця	8:30			Аналіз та тестування програмних систем	ЛК			Методологія дослідження систем *(Сидоренко О.С.)*			ЛК					Основи професійної безпеки та здоров'я людини *(Фомін А.І.)*			ЛК
	10:25	Програмні засоби моделювання фізичних процесів *(Мартиненко Г.Ю.)*	ЛК	Розробка додатків за допомогою .Net	ЛАБ	Аналіз динамічних процесів в CAD/CAE системах *(Мартиненко Г.Ю.)*	ЛК	Графіка в мобільних пристроях *(Шеліхова І.Б)*			ЛК					Фізичні властивості матеріалів *(Зубарєв Є.М.)*	ЛК		
	12:35	Іноземна мова				Іноземна мова		Графіка в мобільних пристроях *(Шеліхова І.Б)*	ЛАБ					Іноземна мова		Фізичні властивості матеріалів	ЛАБ		
																Керування механічними властивостями	ЛАБ		
	14:30					Аналіз динамічних процесів в CAD/CAE системах *(Мартиненко Г.Ю.)*	ЛАБ									ВВ 3 Керування механічними властивостями *(Сіпатов О.Ю.)*	ЛК		
	16:25																		